

## CALL FOR PAPERS

### **Workshop zu Technologien und Werkstoffen der Mikrosystem- und Nanotechnik**

Die Mikrosystemtechnik ist wichtige Schlüsseltechnologie in Bereichen wie der Informations- und Kommunikationstechnik, Medizintechnik, Biotechnologie und Automobilindustrie. Die VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelektronik, Mikrosystem- und Feinwerktechnik veranstaltet am 10. und 11. Mai 2010 in Darmstadt einen Workshop zu Materialien und Technologien der Mikrosystemtechnik. Auf der Materialbasis Silizium haben sich verschiedene Technologien wie Oberflächen-Mikromechanik, Tiefschichtenätzen, poröses Silizium oder Waferbondverfahren entwickelt. Diese und weitere Verfahren stehen im Mittelpunkt des Workshops, zu dem Interessierte bis 15. Januar 2010 Fachbeiträge zu folgenden Themen einreichen können:

#### 3D-Strukturierung von Mikrosystemen (high aspect ratio)

- Tiefenlithographie
- Abformtechniken
- Silizium-Tiefschichtenätzen (DRIE)
- Oberflächen-Mikromechanik, poröses Silizium

#### Polymere Werkstoffe für MST und deren Verarbeitung

#### Drucktechniken für Mikrosysteme

#### Mikroformgebungsverfahren, z.B.

- Spritzgießen, Heißprägen u.a. für verschiedene Materialsysteme
- Nanoimprint-Verfahren

#### Aufbau- und Verbindungstechnik für Mikrosysteme

- Waferbondverfahren für 3D-Mikrosysteme

- Niedertemperatur-Fügeverfahren

Integration von Funktionsmaterialien, wie z.B.

- XMR-Materialien und -Technologien
- Thermoelektrika
- Piezoelektrika
- Dielektrika, Ferroelektrika
- Formgedächtnislegierungen/-polymere
- Nanomaterialien
- Mikrostrukturierbare Kompositmaterialien (u.a. Mikrooptik)

Informationen unter [www.vde.com](http://www.vde.com) und [www.TuW2010.de](http://www.TuW2010.de)

**Pressekontakt:** Melanie Mora, Telefon: 069 6308-461, [melanie.mora@vde.com](mailto:melanie.mora@vde.com)